## 05.3;09.3

# Нелинейно-оптическая диагностика поликристаллических тонких пленок цирконата-титаната свинца

© А.С. Елшин<sup>1</sup>, И.П. Пронин<sup>2</sup>, С.В. Сенкевич<sup>2</sup>, Е.Д. Мишина<sup>1</sup>

<sup>1</sup> МИРЭА — Российский технологический университет, Москва, Россия <sup>2</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: elshin\_andrew@mail.ru

Поступило в Редакцию 6 декабря 2019 г. В окончательной редакции 24 января 2020 г. Принято к публикации 28 января 2020 г.

С помощью нелинейно-оптической микроскопии изучены однофазные (перовскит) и двухфазные (перовскит+пирохлор) тонкие пленки цирконата-титаната свинца, осажденные на подложки Pt/TiO<sub>2</sub>/SiO<sub>2</sub>/Si методом высокочастотного магнетронного распыления при различных расстояниях мишень—подложка (D = 30-70 mm). Обнаружено неоднородное распределение сигнала второй гармоники в сферолитовых перовскитовых островках, в том числе увеличение сигнала на границе перовскит/пирохлор, которое может быть связано с неоднородным распределением механических напряжений. Обсуждаются причины сильного изменения сигнала второй гармоники, его взаимосвязи с изменением характера сферолитовой структуры и условий осаждения пленок при варьировании расстояния мишень—подложка.

Ключевые слова: сегнетоэлектрические тонкие пленки, цирконат-титанат свинца, сферолитовые структуры, нелинейно-оптическая диагностика, генерация второй гармоники.

#### DOI: 10.21883/PJTF.2020.08.49306.18142

Развитие технологий формирования тонких сегнетоэлектрических слоев цирконата-титаната свинца (PZT) позволяет рассматривать эти материалы как перспективные для создания элементов памяти, пьезоэлектрических преобразователей энергии, микроэлектромеханических устройств, приемников инфракрасного излучения и т.д. [1-6]. Для инкорпорации формируемых тонких слоев РZT (субмикронных или микронных толщин) в КМОП-технологии используются, как правило, кремниевые подложки. Физические свойства пленок определяются составом и микроструктурой, которые в свою очередь зависят не только от материала подложки и подслоев, но и от технологических параметров их осаждения и режимов термообработки. При вакуумном методе получения пленок с использованием высокочастотного магнетронного осаждения такими параметрами являются давление и состав рабочего газа, температура подложки, расстояние от мишени до подложки, температура термообработки и т.д. [7-11]. Для получения достоверной информации о микроструктуре и физических свойствах тонких слоев важно использование различных современных и дополняющих друг друга диагностических методов. К их числу относятся не только рентгеноструктурные методы, методы атомно-силовой микроскопии и электронной микроскопии, но и оптические методы, в том числе метод нелинейно-оптической микроскопии, который является информативным для исследования фазовых переходов с изменением кристаллографической симметрии, кристаллографической ориентации, а также доменных структур [12,13]. В сегнетоэлектриках интенсивность генерации второй гармоники (ГВГ) пропорциональна квадрату средней по лазерному пятну составляющей сегнетоэлектрической поляризации, ориентированной нормально к направлению распространения падающего оптического луча [14].

В настоящей работе метод ГВГ использовался для диагностики тонких пленок PZT с составами, соответствующими области морфотропной фазовой границы, где их диэлектрические и электромеханические параметры достигают максимальных значений [15,16]. Пленки осаждались на платинированные кремниевые подложки (Pt/Ti(TiO<sub>2</sub>)/SiO<sub>2</sub>/Si) методом высокочастотного магнетронного распыления керамической мишени при изменении расстояния от мишени до подложки в диапазоне 30-70 mm с шагом 10 mm при давлении рабочего газа, равном 8 Ра, что позволяло "тонко" варьировать состав (элементное соотношение атомов Zr и Ti) в пределах 1.5-2% [17]. Температура последующего отжига, в процессе которого происходило образование фазы перовскита, составляла 580-600°С. Скорость осаждения при таком изменении расстояния уменьшалась более чем в 2 раза. Время осаждения выбиралось таким образом, чтобы толщина пленок была одинаковой и составляла 500 nm. Для расстояний 30 и 40 mm исследовались как однофазные перовскитовые пленки, так и пленки, в которых реализовалась двухфазная структура (при меньшей температуре отжига), состоящая из матрицы низкотемпературной фазы пирохлора (Ру) и отдельных перовскитовых (Ре) островков.

С помощью модифицированного конфокального микроскопа WITec alpha 300S были получены нелинейнооптические изображения поверхности образцов. Вторая оптическая гармоника возбуждалась излучением фемтосекундного лазера на кристалле сапфира, допированно-



**Рис. 1.** РЭМ- (a) и нелинейно-оптические (b) изображения сферолитовых перовскитовых (Pe) островков в пирохлорной (Py) матрице (D = 40 mm). Штриховыми линиями отмечены сечения (1-3).



**Рис. 2.** Распределение сигнала ГВГ по сечению одного (1) и двух (2) сферолитовых островков (*a*) и по круговому сечению (3) при угле поляризации падающего и отраженного лучей 180, 90 и 0° (*b*).

го ионами титана, с длиной волны 800 nm, частотой повторения 80 MHz и длительностью 100 fs. Интенсивность ГВГ на длине волны 400 nm регистрировалась фотоэлектронным умножителем и системой счета фотонов. Поворот плоскости поляризации падающего луча осуществлялся полуволновой пластинкой перед образцом. В качестве анализатора использовалась призма Глана. Изображения фиксировались в геометрии "на отражение". Объектив Zeiss N-achroplan 100X, формирующий пятно на образце диаметром 0.9 µm, и оптическое волокно диаметром 25 µm обеспечили пространственное разрешение ~ 300 nm. Такое разрешение получено потому, что для микроскопии второй гармоники интенсивность сигнала ГВГ пропорциональна квадрату интенсивности падающего луча, что приводит к уменьшению функции размытия точки в  $\sqrt{2}$  раз [18]. Электронно-микроскопические изображения структуры были получены на растровом электронном микроскопе (PЭM) EVO-40 (Zeiss).

На рис. 1 представлены РЭМ- (а) и оптическое на длине волны ГВГ (b) изображения перовскитовых островков. ГВГ-изображение представлено для направления поляризации падающего и отраженного лучей, отмеченного светлой линией. Перовскитовые островки круглой формы характеризовались радиально-лучистой сферолитовой структурой, которая отчетливо наблюдалась как на РЭМ-, так и на ГВГ-изображениях. Видно сильное различие сигнала ГВГ между внутренней и внешней областями островков, о чем свидетельствуют распределения сигнала ГВГ (рис. 2, *a*) вдоль диаметральных (радиальных) сечений одного (рис. 1, сечение 1) и двух островков (рис. 1, сечение 2). При движении от центра сферолита сигнал ГВГ сначала возрастает, достигает локального максимума примерно на середине радиуса, затем спадает к краю и на расстоянии  $\sim 5-7\,\mu{
m m}$  до



**Рис. 3.** Нелинейно-оптическое (ГВГ) изображение сплошной перовскитовой тонкой пленки РZT (D = 30 mm) (a) и зависимость интенсивности сигнала ГВГ, усредненного по площади сканирования, от расстояния D (b).

края снова возрастает. Величина сигнала ГВГ возрастает на краях сферолитов в  $\sim 2$  раза по сравнению с сигналом в центральной области. Подобное поведение может свидетельствовать о формировании в процессе кристаллизации и рекристаллизации фаз перовскита разной плотности, как это было продемонстрировано в [19]. Усиление сигнала ГВГ на краях наблюдается только на границах сферолитовых структур с областью прекурсора (т.е. вблизи фазовой границы Ру/Ре, рис. 1). Вблизи границы слившихся островков усиления не происходит (сечение 2 на рис. 2, *а*). Можно предположить, что это усиление связано с неоднородностью распределения механических напряжений в прикраевых областях.

Круговое сечение (сечение 3 на рис. 1, *b*) сигнала ГВГ сферолитовой структуры при фиксированном направлении поляризации имеет два максимума (рис. 2, b). При повороте входной и выходной поляризации распределение сигнала ГВГ по круговому сечению поворачивается на тот же угол: на рис. 2, *b* приведено три круговых сечения для трех направлений поляризаций луча. Такое поведение может наблюдаться, если сферолит состоит из множественных радиальных кристаллитов (проросших от единого центра кристаллизации) с лежащей в плоскости пленки компонентой поляризации, которая имеет один и тот же угол с радиальным направлением этого кристаллита. Иными словами, кристаллиты с радиальным направлением, отличающимся на заданный угол, будут иметь такой же угол между направлениями поляризации. Чередование минимумов и максимумов интенсивности сигнала ГВГ согласуется с чередованием кристаллитов моноклинной и тетрагональной фаз [17].

Известно, что сигнал ГВГ может усиливаться в зависимости от величины механических напряжений в среде [20]. Ранее с помощью атомно-силовой микроскопии было показано [21], что вследствие разности плотности фаз рельеф на границах Ре/Ру меняется. Ширина области перехода составила порядка 4–5 µm, что согласуется с шириной области усиленного сигнала ГВГ.

На рис. 3, а представлено характерное ГВГ-изображение поверхности образца сплошной пленки сферолитовой микроструктуры. С ростом D величина сигнала ГВГ проходила через максимум и затем резко падала при D = 60-70 mm (рис. 3, b). Эти изменения, как показано в [17], сопровождаются уменьшением числа радиальных лучиков и увеличением их размера. Возможной причиной низкого сигнала ГВГ может быть образование в микроструктуре с большими однородными областями сегнетоэлектрических доменов с характерным размером, меньшим длины волны оптического излучения.

Изменение свойств структуры при вариации расстояния от мишени до подложки может быть связано с особенностями окисления распыленных атомов мишени в процессе осаждения пленок, поскольку, как показали эксперименты, температура подложки за счет разогрева аргоно-кислородной плазмы снижалась от  $160^{\circ}$ С при D = 30 mm до  $90^{\circ}$ С при D = 70 mm. По всей видимости, уменьшение температуры подложки приводило наряду с увеличением длительности осаждения к увеличению вероятности доокисления свинца до четырехвалентного (PbO<sub>2</sub>) состояния, большей однородности состава по площади и объема осажденной пленки [22] и, как следствие, к иному характеру кристаллизации фазы перовскита.

Таким образом, результаты исследования структуры и свойств тонких пленок РZT, осажденных при различных расстояниях от мишени до подложки (30–70 mm), позволяют сделать следующие выводы.

1. Выявлена корреляция изображений сферолитовой перовскитовой структуры тонких пленок, полученных методами ГВГ и РЭМ. Предполагается, что радиальное

изменение интенсивности сигнала ГВГ связано с изменением плотности перовскитовой фазы в процессе ее кристаллизации из фазы пирохлора и ее рекристаллизации в более плотную модификацию.

2. Изменение расстояния от мишени до подложки в процессе осаждения тонких пленок приводило к резкому изменению плотности радиальных лучиков и сигнала ГВГ. Причиной таких изменений могут являться изменения температуры разогрева подложки газовой плазмой и длительности осаждения, приводящих к изменению условий окисления, а при последующем отжиге — к изменению параметров и механизмов кристаллизации фазы перовскита.

#### Финансирование работы

Работа выполнена в рамках госзадания, проект № FSFZ-2020-0022 (Е.Д.М.), а также гранта для молодых ученых РТУ МИРЭА № НИЧ-43 (А.С.Е.).

### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

#### Список литературы

- Воротилов К.А., Мухортов В.М., Сигов А.С. Интегрированные сегнетоэлектрические устройства. М.: Энергоатомиздат, 2011. 175 с.
- [2] Hwang G.T., Annapureddy V., Han J.H., Joe D.J., Baek C., Park D.Y., Kim D.H., Park J.H., Jeong C.K., Park K.I., Choi J.J., Kim D.K., Ryu J., Lee K.J. // Adv. Energy Mater. 2016. V. 6. N 13. P. 1600237. DOI: 10.1002/aenm.201600237
- [3] Yeo H.G., Ma X., Rahn C., Trolier-McKinstry S. // Adv. Funct. Mater. 2016. V. 26. N 32. P. 5940–5946. DOI: 10.1002/adfm.201601347
- [4] Muralt P. // J. Am. Ceram. Soc. 2008. V. 91. N 5. P. 1385– 1396. DOI: 10.1111/j.1551-2916.2008.02421.x
- [5] Muralt P. // Rep. Prog. Phys. 2001. V. 64. N 10. P. 1339–1388.
   DOI: 10.1007/0-387-23319-9\_5
- [6] Scott J.F. // Science. 2007. V. 315. N 5814. P. 954–959.
   DOI: 10.1126/science.1129564
- [7] *Iijima K., Ueda I., Kugimiya K. //* Jpn. J. Appl. Phys. 1991.
   V. 30. Pt 1. N 9B. P. 2149–2151.
- [8] Suu K., Masuda T., Nishioka Y., Tani N. Process stability control of Pb(Zr,Ti)O<sub>3</sub> ferroelectric thin film sputtering for FRAM application // Proc. of the Eleventh IEEE Int. Symp. on applications of ferroelectrics (ISAF XI'98). Montreux, Switzerland, 1998. P. 19–22.
- [9] Alrashda M.H.S., Hamzah A.A., Majlis B.Y. RF sputtered PZT thin film at MPB for piezoelectric harvester devices // 2015 IEEE Regional Symp. on micro and nanoelectronics (RSM). IEEE, 2015. P. 1–4. DOI: 10.1109/RSM.2015.7355018
- Mukhin N.V., Chigirev D.A. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 872.
   P. 012045. DOI: 10.1088/1742-6596/872/1/012045
- [11] Osipov V.V., Kaptelov E.Yu., Senkevich S.V., Kiselev D.A., Pronin I.P. // Ferroelectrics. 2018. V. 535. N 1. P. 78–82. DOI: 10.1080/00150193.2018.1432931

- [12] Denev S.A., Lummen T.T., Barnes E., Kumar A., Gopalan V. // J. Am. Ceram. Soc. 2011. V. 94. N 9. P. 2699–2727. DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04740.x
- [13] *Буряков А.М.* // Рос. технол. журн. 2017. Т. 5. № 2. С. 22– 31. DOI: 10.32362/2500-316X-2017-5-2-22-31
- [14] Dolino G., Lajzerowicz J., Vallade M. // Phys. Rev. B. 1970.
   V. 2. N 6. P. 2194–2200. DOI: 10.1103/PhysRevB.2.2194
- [15] Яффе Б., Кук У., Яффе Г. Пьезоэлектрическая керамика. М.: Мир, 1974. 288 с.
- [16] Noheda B., Cox D.E. // Phase Trans. 2006. V. 79. N 1-2.
   P. 5–20. DOI: 10.1080/01411590500467262
- [17] Pronin V.P., Dolgintsev D.M., Osipov V.V., Pronin I.P., Senkevich S.V., Kaptelov E.Y. // Mater. Sci. Eng. 2018. V. 387. N 1. P. 012063.
- [18] Gauderon R., Lukins P.B., Sheppard C.J.R. // Opt. Lett. 1998.
   V. 23. N 15. P. 1209–1211. DOI: 10.1364/OL.23.001209
- [19] Пронин И.П., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Климов В.А., Зайцева Н.В., Шаплыгина Т.А., Кукушкин С.А. // ФТТ. 2010. Т. 52. В. 1. С. 124–129. DOI: 10.1134/S1063783410010233
- Bertocchi M., Luppi E., Degoli E., Véniard V., Ossicini S. // J. Chem. Phys. 2014. V. 140. N 21. P. 214705. DOI: 10.1063/1.4880756
- [21] Пронин И.П., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Киселев Д.А., Осипов В.В., Пронин В.П. // ФТТ. 2019. Т. 61.
   В. 12. С. 2369–2374. DOI: 10.1134/S1063783419120424
- [22] Тентилова И.Ю., Кукушкин С.А., Каптелов Е.Ю., Пронин И.П., Уголков В.Л. // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37. В. 4. С. 37–43. DOI: 10.1134/S1063785011020295